

モントール・高流量ガス精製装置は、ゲッター式の精製装置で、出口不純物レベルは O₂、H₂O、CO、CO₂、N₂、H₂、THC について 1ppb 以下になります。

この精製装置は、入口ガス不純物レベルが、ファイブナイン(純度 99.999%)以上の純度で定格流量範囲内の運転の場合、1年以上ゲッター筒を交換する必要はありません。

装置内の出入口配管には、ステンレスダイヤフラムバルブ、0.003 μm のパーティクルフィルターが装備されています。

電気系統と配管とが分離されており、電気系統と配管系は別々のドアによりアクセスできます。排気筒とファンが配管側に含まれています。自動安全装置のバイパス弁は標準装備です。

「ライフ状態表示」のランプの点灯によりゲッターの寿命がなくなったことを知らせますので、ゲッター筒を交換して下さい。

マイクロプロセッサの LC 表示で精製状態の確認ができます。制御出力により警報を遠隔で表示できます。コントローラーに接続することで遠隔停止の操作も可能です。

用途

- ・MOCVD-III-V プロセス
- ・光ファイバー製造用
- ・シリコン EPI
- ・クリスタル・プーリング
- ・インプラント
- ・PVD/CVD のプロセスガス用
- ・キャリアガス
- ・フォトリソグラフィ 他

* その他の用途についてはお問い合わせ下さい

精製対象ガス

- ・アルゴン、ヘリウム、その他希ガス
- ・窒素

対象除去不純物

- ・O₂、H₂O、CO、CO₂、N₂、H₂、CH₄
- ・パーティクル



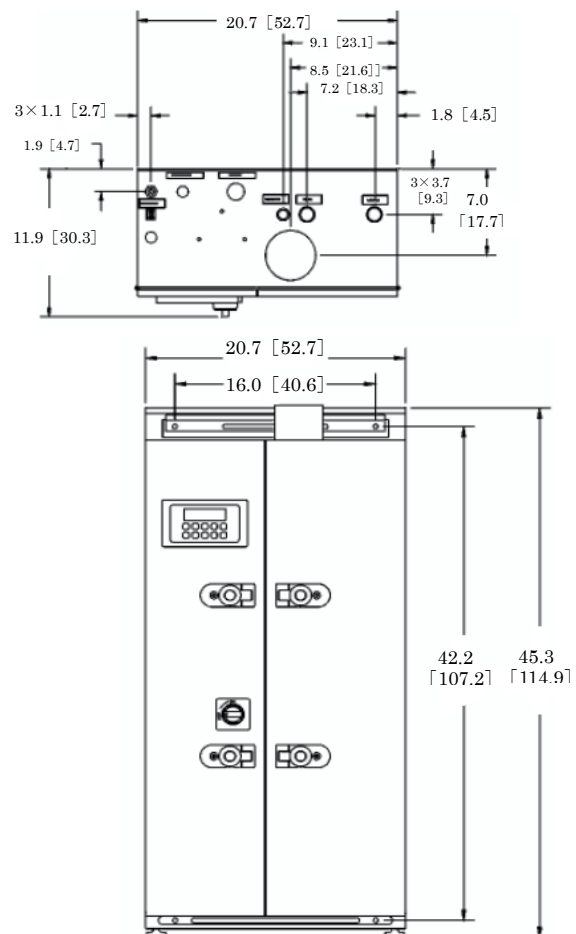
PS4-HIGHFLOW

□寿命:

定格流量で標準的なファイブ・ナインのガスを基準として1年（具体的な寿命についてはお問い合わせください。）

□最大定格流量: 100slpm

□最大圧力: 0.97MPa



インチ [cm]

精製能力

不純物	希ガス	窒素
入口ガス純度: 5-9' s(99.9995%)		
O ₂	<1 ppb	<1 ppb
H ₂ O	<1 ppb	<1 ppb
CO	<1 ppb	<1 ppb
CO ₂	<1 ppb	<1 ppb
N ₂	<1 ppb	N/A
H ₂	<1 ppb	<1 ppb
CH ₄	<1 ppb	<1 ppb

標準仕様

外形寸法(高さ×幅×奥行)	約 113cm × 53 × 30cm
重さ	70kg 以下
入口接続	1/2 インチ VCR オス
出口接続	1/2 インチ VCR オス
ゲッター運転温度	希ガス: 400°C 窒素ガス: 350°C(定格)
パーティクルフィルター	0.003 μm オールメタルタイプ
計装エア入口 接続	3/8 インチ FNPT
圧力 リリーフ ベント接続	1/4 インチ VCR オス
装置周囲必要スペース	正面に 1m 以上のスペース
設備電力(208/240 VAC) 10A	2.4KW(平均電力 1.0W)
熱電対	Kタイプ、SUS シース、3本、無接地
接ガス面仕上げ	平均 10 μm インチ、316L、12RA Max 電解研磨仕上げ

オーダー情報

型式	ガスの種類	電源電圧
PS4-MT50-R-1	希ガス	208VAC
PS4-MT50-N-1	窒素ガス	208VAC
オプション		
PS4-MT50-MODBUS	Modbus 顧客インターフェース接続	
交換用ゲッター筒		
PF4-MT50-R	ハイフロー カラム 希ガス用	
PF4-MT50-N	ハイフローカラム 窒素用	